

## PROVA SCRITTA di DISPOSITIVI ELETTRONICI del 16 luglio 2025

**ESERCIZIO 1** Una giunzione  $pn$  a drogaggio simmetrico, base  $p$  lunga,  $W_n = 5 \mu\text{m}$  (corta),  $\tau_n = 10^{-6} \text{ s}$ ,  $\mu_n = 0.1 \text{ m}^2/\text{Vs}$ , viene caratterizzata misurando una curva  $CV$  (capacità differenziale in funzione della tensione di bias applicata). Si è ottenuto  $C(-5\text{V}) = 61.07 \mu\text{F}/\text{m}^2$ ,  $C(-10\text{V}) = 44.50 \mu\text{F}/\text{m}^2$ .

- 1) Si determini l'espressione analitica di  $1/C^2$  in funzione di  $V$ , per  $V < 0$ . [3]
- 2) Si determini l'espressione numerica, usando i dati delle misure  $CV$ . Si determini poi la differenza di potenziale di contatto e i drogaggi della giunzione. [5]
- 3) Si determini la capacità differenziale per  $V = 0.50 \text{ V}$ , trascurando la carica iniettata nella base corta. [2]

**ESERCIZIO 2** Un transistor  $n$ -MOS polysilicon gate con  $W = L = 6 \mu\text{m}$ , è fabbricato su un substrato  $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ,  $t_{ox} = 20 \text{ nm}$ . La mobilità degli elettroni nel canale risulta  $\mu_n = 0.08 \text{ m}^2/\text{Vs}$ , mentre nel bulk è  $\mu_n = 0.1 \text{ m}^2/\text{Vs}$ ,  $\tau_n = 1 \mu\text{s}$ . È stata misurata la tensione di soglia, che è risultata pari a  $1 \text{ V}$ . Viene applicata una tensione  $V_{GS} = 4 \text{ V}$ .

- 1) Il source è cortocircuitato con il substrato. Determinare la carica parassita nell'ossido, la carica mobile nel canale e la corrente  $I_{DS}$  per  $V_{DS} = -0.6 \text{ V}$  (negativa). Si consideri il canale in regime lineare, e la giunzione Drain substrato che ha un'area pari a  $100 \mu\text{m}^2$ . [3]
- 2) La tensione  $V_{SB}$  viene portata a  $4 \text{ V}$ ,  $V_{GS} = 4 \text{ V}$  e  $V_{DS} = -0.6 \text{ V}$  come nel punto precedente. Determinare la nuova tensione di soglia e la corrente  $I_{DS}$ . (Attenzione! Non cambia solo la tensione di soglia). [4]
- 3) La tensione  $V_{DS}$  viene portata a  $-2 \text{ V}$  ( $V_{SB}$  e  $V_{GS}$  del punto 2). Determinare la carica mobile per  $y = 0$  (in prossimità del Source) e per  $y = L$  (in prossimità del Drain). [3]

**ESERCIZIO 3** Un pezzo di silicio è drogato con atomi donatori (fosforo). Il livello energetico degli atomi donatori si trova  $45 \text{ meV}$  sotto il bottom della banda di conduzione. La concentrazione di portatori è stata misurata a  $50 \text{ K}$ , ed è risultata  $n = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ .

- 1) Determinare la concentrazione di lacune a  $50 \text{ K}$ , dimostrando che è molto piccola, e la posizione del livello di Fermi, dimostrando che è molto vicino al livello dei donatori. [3]
- 2) Determinare la concentrazione di atomi donatori  $N_D$  (si assuma il livello di Fermi coincidente con il livello dei donatori). [3]
- 3) Determinare la concentrazione di elettroni (in banda di conduzione) e di lacune a  $680 \text{ K}$ , nonché la posizione del livello di Fermi, confrontandola con quella che si avrebbe a temperatura ambiente. [4]

NOTA: si usi  $E_G = 1.08 \text{ eV}$ .

### ESERCIZIO 1

Una giunzione  $pn$  a drogaggio simmetrico, base  $p$  lunga,  $W_n = 5 \mu\text{m}$  (corta),  $\tau_n = 10^{-6}$  s,  $\mu_n = 0.1 \text{ m}^2/\text{Vs}$ , viene caratterizzata misurando una curva  $CV$  (capacità differenziale in funzione della tensione di bias applicata). Si è ottenuto  $C(-5\text{V}) = 61.07 \mu\text{F}/\text{m}^2$ ,  $C(-10\text{V}) = 44.50 \mu\text{F}/\text{m}^2$ .

1) Si determini l'espressione analitica di  $1/C^2$  in funzione di  $V$ , per  $V < 0$ . [3]

2) Si determini l'espressione numerica, usando i dati delle misure  $CV$ . Si determini poi la differenza di potenziale di contatto e i drogaggi della giunzione. [5]

3) Si determini la capacità differenziale per  $V = 0.50 \text{ V}$ , trascurando la carica iniettata nella base corta. [2]

### SOLUZIONE 1

1) Per  $V < 0$  la capacità differenziale è quella della regione di svuotamento, quindi avremo (drogaggio simmetrico, quindi  $N_A = N_D = N$ , e  $V < 0$ ):

$$\begin{aligned}C_W &= \frac{\epsilon_s}{\sqrt{\frac{2\epsilon_s}{q} \left( \frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (V_0 - V)}} \\C_W &= \frac{\epsilon_s}{\sqrt{\frac{4\epsilon_s}{qN} (V_0 - V)}} \\ \frac{1}{C^2} &= \frac{4}{\epsilon_s q N} (V_0 - V) \\ \frac{1}{C^2} &= \frac{4}{\epsilon_s q N} (V_0 + |V|)\end{aligned}$$

2) La curva che lega  $1/C^2$  e  $V$  è una retta, i cui parametri possono essere determinati dati due punti. Indicando con  $y = 1/C^2$  avremo:

$$\begin{aligned}y - y_1 &= \frac{y_2 - y_1}{V_2 - V_1} (V - V_1) \\ y_1 &= \frac{1}{C^2(-5 \text{ V})} = 268 \times 10^6 \\ y_2 &= \frac{1}{C^2(-10 \text{ V})} = 504 \times 10^6\end{aligned}$$

Svolgendo i conti, e sostituendo  $y = 1/C^2$ , avremo:

$$\frac{1}{C^2} = -47.37 \times 10^6 V + 31.27 \times 10^6 \quad (1)$$

Quindi avremo, dall'espressione nel punto 1:

$$\begin{aligned}-47.37 \times 10^6 &= \frac{4}{\epsilon_s q N} \\ N &= N_A = N_D = 5 \times 10^{21} \text{ m}^{-3} \\ V_0 &= \frac{31.27 \times 10^6}{47.37 \times 10^6} = 0.66 \text{ V}\end{aligned}$$

È immediato verificare che il valore di  $V_0$  è compatibile con  $N_D = N_A = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ .

3) Basta calcolare  $C_W$  e  $C_{diff}$ , dovuta alla sola iniezione di elettroni nella parte  $p$ .

$$C_W = \frac{\epsilon_s}{\sqrt{\frac{4\epsilon_s}{qN}(V_0 - V)}} = 363 \text{ } \mu\text{F/m}^2$$

$$Q = q \frac{n_i^2}{N_A} L_n e^{\frac{V}{V_T}}$$

$$C_{diff} = \frac{dQ}{dV} = q \frac{n_i^2}{N_A} \frac{L_n}{V_T} e^{\frac{V}{V_T}}$$

$$D_n = \frac{kT}{q} \mu_n = 2.585 \times 10^{-3}$$

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n} = 50.84 \text{ } \mu\text{m}$$

$$C_{diff} = 3.56 \text{ mF/m}^2$$

## ESERCIZIO 2

Un transistor  $n$ -MOS polysilicon gate con  $W = L = 6 \text{ } \mu\text{m}$ , è fabbricato su un substrato  $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ,  $t_{ox} = 20 \text{ nm}$ . La mobilità degli elettroni nel canale risulta  $\mu_n = 0.08 \text{ m}^2/\text{Vs}$ , mentre nel bulk è  $\mu_n = 0.1 \text{ m}^2/\text{Vs}$ ,  $\tau_n = 1 \text{ } \mu\text{s}$ . È stata misurata la tensione di soglia, che è risultata pari a 1 V. Viene applicata una tensione  $V_{GS} = 4 \text{ V}$ .

1) Il source è cortocircuitato con il substrato. Determinare la carica parassita nell'ossido, la carica mobile nel canale e la corrente  $I_{DS}$  per  $V_{DS} = -0.6 \text{ V}$  (negativa). Si consideri il canale in regime lineare, e la giunzione Drain substrato che ha un'area pari a  $100 \text{ } \mu\text{m}^2$ . [3]

2) La tensione  $V_{SB}$  viene portata a 4 V,  $V_{GS} = 4 \text{ V}$  e  $V_{DS} = -0.6 \text{ V}$  come nel punto precedente. Determinare la nuova tensione di soglia e la corrente  $I_{DS}$ . (Attenzione! Non cambia solo la tensione di soglia). [4]

3) La tensione  $V_{DS}$  viene portata a -2 V ( $V_{SB}$  e  $V_{GS}$  del punto 2). Determinare la carica mobile per  $y = 0$  (in prossimità del Source) e per  $y = L$  (in prossimità del Drain). [3]

## SOLUZIONE 2

1) Calcoliamo la tensione di soglia come se non ci fosse carica nell'ossido:

$$\psi_B = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A}{n_i} = 0.347 \text{ V}$$

$$\Phi_{MS} = -\frac{E_G}{2q} + \psi_B = 0.887$$

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = 1.726 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2$$

$$V_{TH} = \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A 2\psi_B}}{C_{ox}} + 2\psi_B + \Phi_{MS} = 0.087 \text{ V}$$

Quindi la carica nell'ossido si calcola come:

$$V_{TH} = V_{TH \text{ senza carica}} - \frac{Q_{ox}}{C_{ox}}$$

$$Q_{ox} = C_{ox}(V_{TH} - V_{TH \text{ senza carica}}) = 1.57 \times 10^{-3} \text{ C/m}^2$$

La  $I_{DS}$  ha due componenti: la corrente nel canale, da calcolare nel modo usuale considerando la carica costante nel canale, e la corrente del diodo  $n^+p$  Drain-substrato, che è polarizzato in diretta con  $V_{DB} = V_{DS} = -0.6$  S  $V_{BD} = 0.6$  V. Per la corrente del diodo (negativa da Drain a Source - Substrato) dobbiamo usare la mobilità del bulk.

$$I_{DS \text{ can}} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} = -248 \text{ } \mu\text{A}$$

$$I_{DS \text{ diodo}} = -I_{SB} = -qS \frac{n_i^2}{N_A} \frac{D_n}{L_n} e^{\frac{V_{BD}}{V_T}}$$

$$D_n = \frac{kT}{q} \mu_n = 2.585 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n} = 50.84 \text{ } \mu\text{m}$$

$$I_{DS \text{ diodo}} = -0.22 \text{ } \mu\text{A}$$

$$I_{DS} = -248.2 \text{ } \mu\text{A}$$

La corrente del diodo è più piccola di quella del canale, comunque da verificare.

2) La tensione di soglia si modifica per l'effetto Body:

$$V_{TH \text{ new}} = \frac{V_{TH} + \sqrt{2\epsilon_s q N_A (2\psi_B + V_{SB})}}{C_{ox}} - \sqrt{2\epsilon_s q N_A 2\psi_B}$$

$$V_{TH} = 1 + 0.729 - 0.280 = 1.449 \text{ V}$$

Quindi la  $V_{TH}$  si modifica di poco. In questo caso, però, la tensione  $V_{DB}$  risulta positiva, poiché avremo:

$$V_{DB} = V_{DS} + V_{SB} = -0.6 + 4 = 3.4 \text{ V} \quad (2)$$

Quindi adesso la giunzione Drain-substrato è polarizzata in inversa, e la conduzione avviene solo nel canale, come nel punto precedente. La corrente  $I_{DS}$  rimane comunque negativa.

$$I_{DS} = I_{DS \text{ can}} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} = -211 \text{ } \mu\text{A} \quad (3)$$

3) Le cariche fisse e mobili si calcolano nel modo usuale, facendo attenzione alla polarizzazione del Gate rispetto al Source e al Drain. Da notare in particolare che la polarizzazione del Drain rispetto al substrato rimane positiva (giunzione  $n^+p$  in inversa). Le cariche sono negative, si riporta il valore assoluto:

$$Q_n(0) = C_{ox}(V_{GS} - V_{TH}) = 2.68 \times 10^{-3} \text{ C/m}^2$$

$$V_{GD} = V_{GS} - V_{DS} = 4 - (-2) = 6 \text{ V}$$

$$Q_n(L) = C_{ox}(V_{GD} - V_{TH}) = 7.85 \times 10^{-3} \text{ C/m}^2$$

### ESERCIZIO 3

Un pezzo di silicio è drogato con atomi donatori (fosforo). Il livello energetico degli atomi donatori si trova 45 meV sotto il bottom della banda di conduzione. La concentrazione di portatori è stata misurata a 50 K, ed è risultata  $n = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ .

1) Determinare la concentrazione di lacune a 50 K, dimostrando che è molto piccola, e la posizione del livello di Fermi, dimostrando che è molto vicino al livello dei donatori.[3]

2) Determinare la concentrazione di atomi donatori  $N_D$  (si assuma il livello di Fermi coincidente con il livello dei donatori).[3]

3) Determinare la concentrazione di elettroni (in banda di conduzione) e di lacune a 680 K, nonché la posizione del livello di Fermi, confrontandola con quella che si avrebbe a temperatura ambiente. [4]

NOTA: si usi  $E_G = 1.08 \text{ eV}$ .

### SOLUZIONE 3

1) Calcoliamo  $n_i$  a 50 K:

$$\begin{aligned}N_C(50 \text{ K}) &= N_C(300 \text{ K}) \left(\frac{50}{300}\right)^{\frac{3}{2}} = 1.9 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3} \\N_V(50 \text{ K}) &= N_V(300 \text{ K}) \left(\frac{50}{300}\right)^{\frac{3}{2}} = 6.8 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3} \\n_i(50 \text{ K}) &= \sqrt{N_C N_V} e^{-\frac{E_G}{2kT}} = 4 \times 10^{-37} \text{ cm}^{-3}\end{aligned}$$

Quindi  $p = n_i^2/n$  è trascurabile, e avremo che  $n$  coincide praticamente con la concentrazione di donatori ionizzati  $n = N_D^+$ , dove  $N_D^+ < N_D$ .

La posizione del livello di Fermi si trova con la relazione usuale:

$$\begin{aligned}n &= N_C e^{-\frac{E_C - E_f}{kT}} \\E_C - E_f &= kT \ln \frac{N_C}{n} = 0.030 \text{ eV}\end{aligned}$$

Quindi il livello di Fermi è molto vicino al livello dei donatori.

2) Usiamo la relazione:

$$\begin{aligned}N_D^+ &= \frac{N_D}{1 + 2e^{\frac{E_f - E_D}{kT}}} \\N_D &= N_D^+ \left(1 + 2e^{\frac{E_f - E_D}{kT}}\right) \\N_D &= N_D^+ \left(1 + 2e^{\frac{E_f - E_C + E_C - E_D}{kT}}\right) \\N_D &= N_D^+ \left(1 + 2e^{\frac{E_C - E_D - (E_C - E_f)}{kT}}\right) = 6 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}\end{aligned}$$

3) Bisogna calcolare  $n_i$  a 680 K:

$$N_C(680 \text{ K}) = N_C(300 \text{ K}) \left(\frac{680}{300}\right)^{\frac{3}{2}} = 9.5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_V(680 \text{ K}) = N_V(300 \text{ K}) \left( \frac{680}{300} \right)^{\frac{3}{2}} = 3.4 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_i(50 \text{ K}) = \sqrt{N_C N_V} e^{-\frac{E_G}{2kT}} = 5.6 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

Quindi  $n_i \approx N_D$ . Per calcolare  $n$  bisogna usare la relazione:

$$n = \frac{N_D^+}{2} + \sqrt{\frac{N_D^{+2}}{4} + n_i^2} \quad (4)$$

Data la temperatura, ben al di sopra di quella allo svuotamento, avremo  $N_D^+ = N_D$ , e quindi  $n = 1.2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ . Dalla legge dell'azione di massa possiamo calcolarci la concentrazione di lacune  $p = n_i^2/n = 2.6 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ . La posizione del livello di Fermi si calcola con la relazione solita:

$$n = N_C(680 \text{ K}) e^{-\frac{E_C - E_f}{kT}}$$

$$E_C - E_f = kT \ln \frac{N_C}{n} = 0.525 \text{ eV}$$

Quindi è molto vicino alla metà del gap (livello di Fermi intrinseco): il semiconduttore è quasi intrinseco. A temperatura ambiente avremo infatti  $n = N_D$ :

$$n = N_C(300 \text{ K}) e^{-\frac{E_C - E_f}{kT}}$$

$$E_C - E_f = kT \ln \frac{N_C}{n} = 0.223 \text{ eV}$$

ben al di sopra del livello di Fermi intrinseco.